

**LaAlO<sub>3</sub>/SrTiO<sub>3</sub>界面電子状態の放射光光電子分光による研究**

Electronic structure at the interface between LaAlO<sub>3</sub>/SrTiO<sub>3</sub>  
studied by synchrotron radiation photoemission spectroscopy

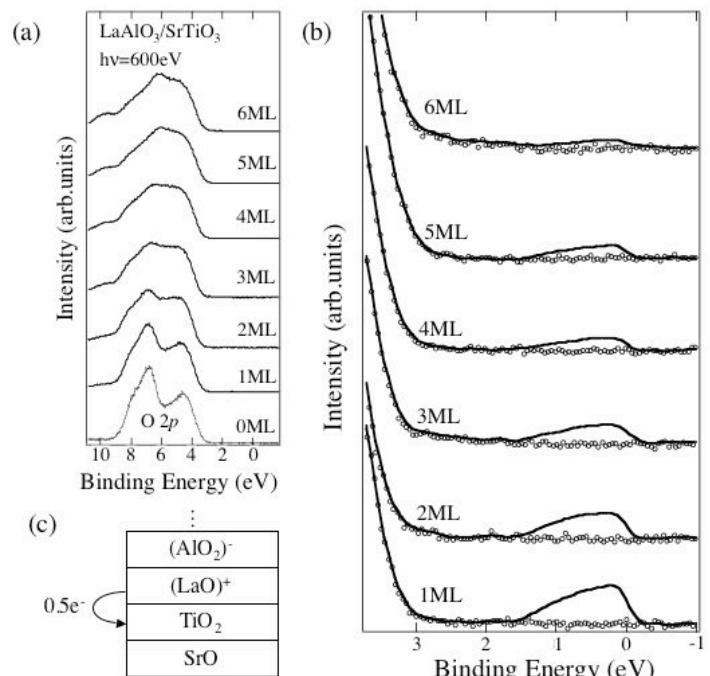
東大工<sup>1</sup>, JST-CREST<sup>2</sup>○ 吉松公平<sup>1</sup>, 安原隆太郎<sup>1</sup>, 組頭広志<sup>1,2</sup>, 尾嶋正治<sup>1,2</sup>The University of Tokyo<sup>1</sup>, JST-CREST<sup>2</sup>○ K. Yoshimatsu<sup>1</sup>, R. Yasuhara<sup>1</sup>, H. Kumigashira<sup>1,2</sup>, and M. Oshima<sup>1,2</sup>

**1. はじめに** 近年、ペロブスカイト酸化物 SrTiO<sub>3</sub>/LaAlO<sub>3</sub> ヘテロ界面における high-mobility state の存在が報告され注目を浴びている。この high-mobility state を利用することで、新たな酸化物電界効果トランジスター等のデバイス応用の可能性が期待できる。しかしながら、SrTiO<sub>3</sub> と LaAlO<sub>3</sub> の界面における伝導の起源については、ヘテロ界面における電荷移動による説と、LaAlO<sub>3</sub> 堆積により誘起された SrTiO<sub>3</sub> 側の酸素欠損に起因する説があり、未だにその機構は明らかになっていない。デバイス設計には、high-mobility state の起源を明らかにし、その物性を制御することが必要不可欠である。そこで、本研究では *in-situ* 放射光光電子分光により、LaAlO<sub>3</sub>/SrTiO<sub>3</sub> ヘテロ界面の電子状態を明らかにすることで、その起源を解明することを目的とした。

**2. 実験方法** レーザー-MBE 法により Nb-SrTiO<sub>3</sub>(001) 基板上に基板温度 700 °C、酸素分圧 10<sup>-5</sup> Torr の条件で、膜厚 20 ML の SrTiO<sub>3</sub> 薄膜を作製し、その上に、LaAlO<sub>3</sub> 薄膜を 0~6 ML 堆積した。膜厚は反射高エネルギー電子回折 (RHEED) 振動をモニターすることで、原子レベルで制御し、膜の表面モフォロジーと結晶性については、原子間力顕微鏡 (AFM) と X 線回折 (XRD) で評価した。

**3. 結果と考察** 図 1(a) に LaAlO<sub>3</sub>/SrTiO<sub>3</sub> 薄膜の

価電子帯スペクトルを、また図 1(b) にフェルミ準位近傍の拡大図を示す。O 2p の形状は、LaAlO<sub>3</sub> 膜厚の増加に伴う系統的な変化が見られるのに対し、フェルミ準位上は変化が全く見られない。図 1(b) の実線は、図 1(c) のように LaAlO<sub>3</sub>/SrTiO<sub>3</sub> ヘテロ界面の一層のみで、(LaO<sup>+</sup>) 層から TiO<sub>2</sub> 層に単位格子あたり 0.5e<sup>-</sup> の電荷移動が起こり、Ti 3d バンドに電子がドープされた場合のシミュレーション結果である。しかしながら、実験結果では、電荷移動による Ti 3d ピークは全く見られない。一方、Ti 2p 内殻スペクトルでは、LaAlO<sub>3</sub> 膜厚の増加に伴い、バンドベンドによる高結合エネルギー側へのシフトが見られている。これらの結果は、LaAlO<sub>3</sub>/SrTiO<sub>3</sub> ヘテロ界面の high-mobility state の起源は電荷移動ではなく、SrTiO<sub>3</sub> 側に誘起された酸素欠損に起因していることを示している。すなわち、伝導性の起源は LaAlO<sub>3</sub> 堆積により SrTiO<sub>3</sub> 側に酸素欠損が誘起され、その欠損により生じたキャリアがバンドベンドした界面に流れ込むことであると考えられる。

(a) LaAlO<sub>3</sub>/SrTiO<sub>3</sub> 価電子帯スペクトル

(b) (a)のフェルミレベル近傍の拡大図

(白丸が実際のスペクトル、

実線はシミュレーションによる Ti 3d バンド)

(c) LaAlO<sub>3</sub>/SrTiO<sub>3</sub> 界面の電荷移動の模式図